

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【公表番号】特表2007-537495(P2007-537495A)

【公表日】平成19年12月20日(2007.12.20)

【年通号数】公開・登録公報2007-049

【出願番号】特願2007-513371(P2007-513371)

【国際特許分類】

G 0 2 B 5/124 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 5/124

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月9日(2008.5.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光を再帰反射するように形成される表面を有する第 1 の複数の再帰反射体；および第 1 の所定の波長または波長範囲の光を反射し、同時に、第 2 の所定の波長または波長範囲の光を通過させるように形成される表面上のコーティング、を備える、再帰反射性構造。

【請求項 2】

光を再帰反射するように形成された表面を有する第 2 の複数の再帰反射体および第 1 の所定の波長または波長範囲の光を反射し、同時に、第 2 の所定の波長または波長範囲の光を通過させるように形成される第 2 の複数の表面の表面上のコーティングをさらに備え、第 1 および第 2 の複数の表面は、少なくとも 2 つの方向に光を再帰反射するように形成される、請求項 1 記載の構造。

【請求項 3】

前記第 1 および / または第 2 の複数の再帰反射体が、オープンフェイスの表面を備える表面を有する、請求項 1 記載の構造。

【請求項 4】

オープンフェイスの表面を有する第 1 および / または第 2 の複数の再帰反射体が、反対の方向に光を再帰反射するように背中合わせの関係で配置される、請求項 3 記載の構造。

【請求項 5】

反対方向に光を再帰反射するようにさらに形成される構造であって、該構造が材料のシートから形成されるか、または射出、圧縮成形、マイクロ鋳造、射出精密成形、および / もしくは熱成形プロセスによって形成される、請求項 4 記載の構造。

【請求項 6】

材料のシートが、金属および / もしくはポリマーを含む、または材料のシートが、順送型プロセスによってオープンフェイスの再帰反射性構造に形成される、または

構造が、5、7 もしくは 13 の面を備える、または

構造が、可視光に実質的に透明な材料から形成され、かつ少なくとも 1 つの側面にコーティングを備え、該コーティングが、第 1 の波長もしくは波長範囲の光を反射し、同時に、第 2 の波長もしくは波長範囲の光を通過させるように形成される、または

構造が、部分に壊れやすい、または
構造が、構造の１つ以上の表面に提供される A z t e c 構造を備える、または、
構造が、フレックもしくは系の形状に形成される、

請求項 5 記載の構造。

【請求項 7】

少なくとも 2 つの方向に光を再帰反射するように形成される、複数のオープンフェイスの正方形の表面を有するコーナーキューブプリズムを備える、再帰反射性系。

【請求項 8】

プリズムが、その上に正反射性または反射性コーティングを有する、請求項 7 記載の系。

【請求項 9】

プリズムが、所定の波長または波長範囲の光を反射するように形成される、コーティングをその上に有する、請求項 7 記載の系。

【請求項 10】

所定の波長もしくは波長範囲の光が、短波長、中程度の波長もしくは長波長の光を含む、または

実質的に中空のチューブもしくはクラディング中に封入される、または

可撓性も線もしくはブレイクポイントを含む、または

チューブもしくはクラディングが、液晶材料で充填され、チューブもしくはクラディングの内面が、インジウムスズ酸化物の透明コーティングを備える、

請求項 9 記載の系。

【請求項 11】

8 つの端を切り取った中実のコーナーキューブプリズムを備える、八面体再帰反射体。

【請求項 12】

プリズムが形成され、次いで、八面体再帰反射体に折り畳まれる、または

プリズムの切子面上に正反射性もしくは反射性コーティングをさらに備える、または

金属もしくはポリマーを含む、または

順送型プロセス、熱成形プロセス、ステップ鋳造プロセス、圧縮、圧縮射出および / もしくは射出精密成形プロセスによって形成される、または

コーティングが、プリズムの切子面上に配置され、かつ所定の波長もしくは波長範囲の光を反射し、同時に、所定の波長もしくは波長範囲の光を通過させるように形成される、または

プリズムの切子面について差動高さ探査装置をさらに含む、または

中空もしくは中実の構造内に封入される、または

完全なオープンフェイスプリズム表面を備える、または

表面に正反射性もしくは反射性コーティングをさらに備える、

請求項 11 記載の再帰反射体。

【請求項 13】

所定の波長を有する光を再帰反射するように形成される再帰反射性構造を、物体の表面に貼り付ける工程；

再帰反射性構造に所定の波長を有する光を指向する工程；および

再帰反射された光を検出する工程、

を包含する、物体を同定する方法。

【請求項 14】

再帰反射性構造が、所定の波長を有する光を少なくとも 2 つの方向に再帰反射するように形成される、請求項 13 記載の方法。